

# 프로브 회전형 원자현미경의 프로브 정렬도 측정 방법

출원번호 | 10-2015-0128771  
등록번호 | 10-1738257

대분류                      반도체    |    분류                      표면검사    |    응용분야                      표면검사장치

## 기술개요

프로브의 중심과 회전중심간의 정렬도를 측정하고 이를 보정하는 방법에 관한 기술

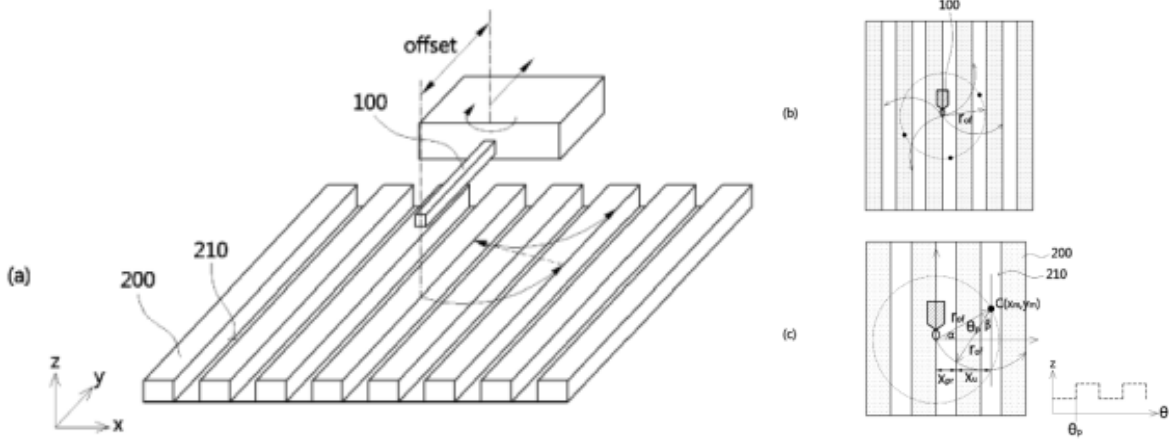
## 기술 경쟁력 및 특징

### 기존 기술 문제점

- 기존에는 정렬기구를 이용하여 프로브의 시편 접촉점과 회전중심의 불일치도는 정렬기구를 사용하여 보정을 했음
- 그러나 불일치도(정렬도)를 측정하기가 용이하지 않으며, 오차가 나노미터 수준이므로 정렬기구를 사용한다고 하더라도 분해능의 한계에 의해 정확한 보정이 쉽지 않은 문제점이 있었음

### 본 기술의 특징

- 프로브 접촉점과 프로브의 회전중심의 정렬도를 측정하고 그 측정결과에 따라 차이를 보상함으로써, 이방성 재료의 임의의 방향으로의 표면 특성과 측정하고자 하는 시편의 완전한 3차원을 나노미터 수준의 정밀도로 측정할 수 있음



<본 기술에 의한 프로브 회전형 원자현미경의 프로브 정렬도 측정 방법>

## 적용분야

· 원자현미경

## TRL 단계

1	2	3	4	5	6	7	8	9
기초연구 단계	실험 단계	시작품 단계	실용화 단계	사업화				